## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-297209

(43)Date of publication of application: 12.11.1993

(51)Int.Cl.

G02B 5/18

(21)Application number: 04-104738

(71)Applicant:

OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

23.04.1992

(72)Inventor:

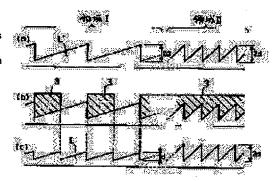
ISHII TETSUYA

# (54) MANUFACTURE OF UNEQUALLY SPACED DIFFRACTION GRATING

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an unequal space diffraction grating that has been optimized in the desired diffraction orders respectively in the different regions inside the diffraction grating surface, and whose sectional shape has been formed in sawteeth.

CONSTITUTION: In the first process, an unequally spaced diffraction grating (L') having a sawtooth-shaped sectional shape and in which the diffraction efficiency has been optimized with regard to higher order diffracted light is formed. In the second process, the sectional structure is divided by etching while keeping the sawtooth shape in an arbitrary region inside the diffraction grating surface to form a region where the diffraction efficiency of the lower order diffracted light has been optimized and also the desired diffraction angle has been achieved by the diffracted light, so that an unequal space diffraction grating (L) can be obtained.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-297209

(43)公開日 平成5年(1993)11月12日

(51) Int. C1. 5

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G02B 5/18

9018-2K

審査請求 未請求 請求項の数2

(全5頁)

(21)出願番号

特願平4-104738

(22)出願日

平成4年(1992)4月23日

(71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 石井 哲也

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オ

リンパス光学工業株式会社内

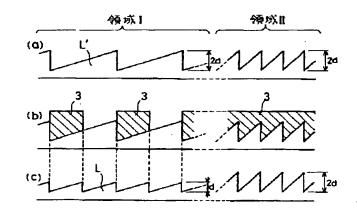
(74)代理人 弁理士 篠原 泰司 (外1名)

(54) 【発明の名称】不等間隔回折格子の製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 回折格子面内の異なる領域において夫々所望の回折次数で最適化された、断面形状が鋸歯に加工された不等間隔回折格子を提供する。

【構成】 第1の工程で高次の回折光について回折効率 が最適化された鋸歯状の断面形状を有する不等間隔回折格子(L')を形成する。第2の工程でこの回折格子面内の任意の領域において、エッチングにより鋸歯形状を保ったまま断面構造を分割して、より低次の回折光の回折効率が最適化され且つ所望の回折角がその回折光で達成された領域を形成し、不等間隔回折格子(L) を得る。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 任意の次数の回折光について、ある所定 の回折効率を満足するような鋸歯状の断面形状を有する 不等間隔回折格子を形成する第1の工程と、

該第1の工程で形成された不等間隔回折格子の任意の領 域において、鋸歯形状を保ったまま断面構造を分割し又 は結合することによって、より低次又は高次の回折光の 回折効率が最適化され、且つ、所望の回折角が該低次又 は高次の回折光で達成された領域を形成する第2の工程 とから成る、不等間隔回折格子の製造方法。

【請求項2】 回折格子の断面構造を分割又は結合する 第2の工程は、回折格子の一部の領域の厚さを、エッチ ングにより減少させ、又は適当な物質を堆積させて増加 させるフォトリソグラフィープロセスであることを特徴 とする、請求項1に記載の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、鋸歯状の断面形状を有 する不等間隔回折格子の製造方法にかかり、特に回折格 子面内の異なる領域で所望の次数の回折光の回折効率を 20 最適化した不等間隔回折格子の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】回折格子の断面形状を鋸歯状化すること により回折効率が向上され得ることは従来より知られて いる。図4は断面形状を鋸歯状に形成し且つレンズ作用 を持つように間隔を調整して回折格子を加工した回折型 レンズの正面図、図5はその略断面図であるが、このよ うに、レンズの断面形状が完全に鋸歯状の場合、ブレー ズ条件を満足する波長において100パーセントに近い 回折効率を達成することができる。又、回折型レンズに 30 レンズ作用を与える場合、同心円の外周付近における回 折角を内周付近の回折角より大きくする必要があるが、 この場合、図5に示す如く、外周付近の領域[[における 格子間隔P2が内周付近の領域Ⅰにおける格子間隔P1 より小さくなることが一般的である。

【0003】しかし、実際にこのような回折型レンズを 製造する場合、領域IIにおける格子間隔P2は加工装置 の加工寸法精度に依存するため、この加工精度上の限界 からレンズ設計上の制限が生じていた。この制限は、よ り高性能な回折型レンズを製造する際の妨げとなってい 40 た。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、回折格子の 回折角と格子間隔の関係は、回折格子への入射光線角を θ, 射出光線角をθ', 格子間隔をP, 入射光線波長を 入としたとき、次式(1)で与えられる。

 $sin\theta'-sin\theta=m\lambda/P$ (1) 但し、mは回折次数(0, ±1, ±2, ・・・)であ る。この式(1)から、より高次の回折光を利用すれ ば、低次の回折光を利用した場合の入射光線角θと射出 50 いて、鋸歯形状を保ったまま断面構造を分割し又は結合

光線角をθ′の関係と同じ関係が、より広い格子間隔で 得られることがわかる。即ち、より高次の回折光で最適 化された回折格子ほど、回折格子全域に渡って格子間隔 を広くすることができ、上述した設計上の制限が緩和さ れることを示している。

【0005】一方、回折格子の厚さに関しては、例えば 図5に示した如き鋸歯状の断面形状を有する回折格子に おいて、その格子厚即ち回折格子の表面レリーフ構造の 深さを極めて薄く (浅く) すれば、一定の次数の範囲内 10 で、回折光の回折効率を次数に関わらず100パーセン トにすることができる。従って、この次数の範囲内で は、回折格子を最も高次の回折光で最適化すれば、格子 間隔の広がりにより加工精度上の制限が緩和され、且つ 低次の回折光に対しても最適化され得ることとなり、設 計においてより有利となる。しかし、実際には、高次の 回折光で最適化された回折格子は、格子厚が厚くならざ るを得ず、従って回折効率は低下する。

【0006】このように、高次の回折光を利用した回折 型レンズには、格子間隔を広くできる長所と格子厚が厚 くなる短所が共存するが、かかる長所を有効に利用し て、回折型レンズの集光効率を高め且つ設計上の制限を 緩和する方法としては、格子間隔が十分広く加工が用意 な領域においては低次の回折光を利用し、格子間隔が狭 く加工が困難な領域においては高次の回折光を利用する 方法がある。図5を用いてこれを説明すれば、例えば格 子間隔が広いレンズ中心付近の領域 I において 1 次の回 折光を利用し、格子間隔が狭い外周付近の領域川におい て2次の回折光を利用するようにすれば、領域!!におけ る格子間隔は、この領域で1次回折光を利用して最適化 された場合と比較して2倍の間隔で加工され得るので、 製造上の余裕度を向上させることができる。又、領域Ⅰ においては1次回折光を利用しているので、この回折型 レンズ全体を2次の回折光で構成した場合よりも、集光 効率を高くすることができる。

【0007】このように不等間隔回折格子の一部の領域 で高次の回折光を利用し得るようにすることが有意義で あるにも関わらず、かかる不等間隔回折格子を実際に製 造する方法は従来なかった。

【0008】本発明は、従来の技術の有するこのような 問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすると ころは、回折格子面内の異なる領域において夫々所望の 回折次数で最適化された、断面形状が鋸歯に加工された 不等間隔回折格子を提供することにある。

## [0009]

【課題を解決するための手段】本発明による不等間隔回 折格子の製造方法は、任意の次数の回折光について、あ る所定の回折効率を満足するような鋸歯状の断面形状を 有する不等間隔回折格子を形成する第1の工程と、第1 の工程で形成された不等間隔回折格子の任意の領域にお することによって、より低次又は高次の回折光の回折効率が最適化され、且つ、所望の回折角が該低次又は高次の回折光で達成された領域を形成する第2の工程とから成ることを特徴としている。

【0010】又、上記回折格子の断面構造を分割し又は結合する第2の工程は、回折格子の一部の領域の厚さを、エッチングにより減少させ、又は適当な物質を堆積させて増加させるフォトリソグラフィープロセスであることを特徴としている。

## [0011]

【作用】高次の回折光で回折効率が最適化された不等間隔回折格子において、格子間隔Pが十分広い領域における回折効率を向上させるため、この領域で最適化する場合、光線が回折格子に垂直に入射したときのm次回折光の回折角  $\theta$  は、前記式(1)より、次式(2)で与えられる。

$$s i n \theta = m \lambda / P$$
 (2)

又、鋸歯状の断面形状をもった回折格子がm次の回折光で最適化されているとすると、そのときの格子厚Dは、次式(3)で与えられる。

$$D = m \lambda / (n-1)$$
 (3)

但し、nはこの回折格子が形成されている基板の屈折率である。従って、回折角  $\theta$  を変化させないで 1 次の回折光で最適化された領域を形成するためには、式(2),(3)より、かかる領域の格子間隔 P と格子厚D を 1 / m倍にすればよい。

【0012】図1は本発明の原理を説明するための図で あって、(a)は第1の工程で形成された断面形状が鋸 歯状に加工された不等間隔回折格子の一部の領域を示す 略断面図、(b)はこの回折格子の断面を分割する第2 の工程を示す回折格子の略断面図、(c)は第2の工程 で形成される回折格子の一部の領域を示す略断面図であ る。図中、L′は第1の工程で形成される回折格子、L は第2の工程で形成される回折格子、Pは格子間隔、D は格子厚である。ここで、この回折格子は第1の工程で 3次の回折光で最適化されているとすると、1次の回折 光で最適化された領域を形成するためには、同図(a) で示す回折格子の1周期分の断面構造を同図 (b) に示 すように区切り、同一形状の部位1を鋸歯状の斜面に沿 って3箇所に形成すればよい。このとき、部位1の形状 40 は同図(a)の1周期分の鋸歯形状を1/3の大きさに. 縮小したものに相当する。同図(b)における部位1の 底部 2 を同一面内に揃えたものが同図 (c) であるが、 これは第1の工程で形成された回折格子の格子間隔Pと 格子厚Dをそれぞれ1/3倍にしたものに相当し、上記 式(2),(3)より、このような操作をした領域が回 折角を変化させずに、1次の回折光で最適化されている

【0013】又、同図(a)乃至(c)の逆の過程により、即ち隣接する格子の鋸歯状の斜面を結合することに 50

ことがわかる。

より、低次の回折光で最適化された、例えば回折格子の 外周付近の領域を、回折角を変化させることなく、より 高次の回折光で最適化させることができる。

#### [0014]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。

#### 第1実施例

図2は、第1実施例により不等間隔の回折格子で成る回 折型レンズが形成される工程を示した回折格子の略断面 図である。本実施例の回折型レンズは、格子間隔の広い 中心付近の領域Iにおいては1次の回折光を利用し、格 子間隔の狭い外周付近の領域IIにおいては2次の回折光 を利用しようとするものである。

【0015】先ず、同図(a)に示すように2次の回折 光について回折効率が最適化された鋸歯状の断面形状を 有する回折型レンズL′をガラス基板上に形成する。図 中、2dは格子厚を示している。このように断面形状を 鋸歯形状に加工する方法としては、例えば特開平3-1 20501号公報で開示されているように、機械加工や 収束ビームによる加工等の公知の方法を利用すればよ

【0016】2次の回折光で最適化された回折型レンズの一部の領域に、1次の回折光で最適化された領域を形成するためには、その領域において格子厚と格子間隔を夫々1/2倍すればよく、これをフォトリソグラフィーの手法により実現する。即ち、同図(a)で示した回折格子表面にフォトレジスト3を塗布し、1次の回折光で最適化させる領域Iのみに、同図(b)で示すように下地のパターンと同周期でデューティー比が1:1のパイナリーパターンを形成する。

【0017】そして、この基板に深さdの異方性エッチングを施した後、レジストを剥離すれば、最終的に同図(c)に示すように、格子間隔の広い中心付近の領域 Iにおいては1次の回折光が利用され、格子間隔の狭い外周の領域IIにおいては2次の回折光が利用され得る、格子間隔と格子厚が調整された回折型レンズLが形成される。

# 【0018】 第2 実施例

図3は、第2実施例により不等間隔の回折格子で成る回 折型レンズが形成される工程を示した回折格子の略断面 図である。本実施例の回折型レンズは、格子間隔の広い 中心付近の領域Iにおいては1次の回折光を利用し、格 子間隔の狭い外周付近の領域IIにおいては3次の回折光 を利用しようとするものである。

【0019】先ず、同図(a)に示すように、3次の回 折光について回折効率が最適化された鋸歯状の断面形状 を有する回折型レンズL′をガラス基板上に形成する。 図中、3dは格子厚を示している。断面形状を加工する 方法は、前記第1実施例で説明した適宜な方法による。

【0020】3次の回折光で最適化された回折型レンズ

の一部の領域に、1次の回折光で最適化された領域を形成するためには、その領域において格子厚と格子間隔を夫々1/3倍すればよい。これをフォトリソグラフィーの手法により実現するためには、同図(a)で示した回折格子表面にフォトレジスト4を塗布し、1次の回折光で最適化させる領域Iのみに、同図(b)で示すように下地のパターンと同周期でデューティー比が1:2のバイナリーパターンを形成する。

【0021】この基板に深さ2dの異方性エッチングを施した後、レジストを剥離すれば、同図(c)に示す断 10 面形状の格子パターンが形成される。更に、同図(c)で示したパターン表面にフォトレジスト5を塗布し、1 次の回折光で最適化させる領域 I のみに、同図(d)で示すように下地のパターンと同周期でデューティー比が 1:2のパイナリーパターンを形成する。そして、この基板に深さdの異方性エッチングを施した後、レジストを剥離すれば、最終的に同図(e)で示すように、格子間隔の広い中心付近の領域 I においては 1 次の回折光が利用され、格子間隔の狭い外周の領域IIにおいては 3 次の回折光が利用され得る、格子間隔と格子厚が調整されの回折光が利用され得る、格子間隔と格子厚が調整された回折型レンズLが形成される。

【0022】上述の実施例では、断面構造を分割する方法として異方性エッチングを用いたが、この工程を、基板と同じ光学的性質を有する材料を堆積することにより、隣接する格子の鋸歯状の斜面を結合する工程に置き換えても同様な結果が得られる。又、本発明においては、回折格子の断面形状を鋸歯形状に加工する方法に制限はない。

## [0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、い 30 1・・・部位かなる方法で回折格子の断面形状を鋸歯形状に加工する ・レジスト場合においても、所望の領域において、所望の次数の回 L ・・・第1 折光で回折効率が最適化された不等間隔回折格子を製造 L ・・・第1

することができる。このことは、従来の製造プロセスを 殆ど変更する必要がないことを示している。又、本発明 によれば、回折格子面内の領域によって回折次数が異なるにも関わらず、特定の次数で不等間隔回折格子を設計 し、その後に任意の領域における回折次数を変化させる ことができるため、設計上の煩わしさを低減できる。従 って、回折格子面内の異なる領域において夫々所望の回 折次数で最適化されていて断面形状が鋸歯に加工された 不等間隔回折格子を容易に提供することができる。

## 0 【図面の簡単な説明】

【図1】(a) 乃至(c) は夫々本発明により回折格子の一部の領域が任意の次数の回折光で最適化される工程を示した断面形状が鋸歯状に加工された不等間隔回折格子の略断面図である。

【図2】 (a) 乃至(c) は夫々本発明の第1実施例により2次の回折光で最適化された回折格子の一部の領域が1次の回折光で最適化される工程を示した断面形状が鋸歯状に加工された不等間隔回折格子の略断面図である。

0 【図3】(a)乃至(e)は夫々本発明の第2実施例により3次の回折光で最適化された回折格子の一部の領域が1次の回折光で最適化される工程を示した断面形状が 鋸歯状に加工された不等間隔回折格子の略断面図である。

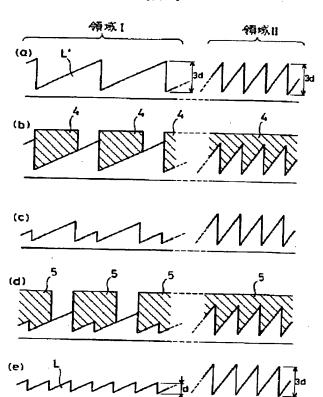
【図4】断面形状を鋸歯状に形成し且つレンズ作用を持つように間隔を調整して回折格子を加工した回折型レンズの正面図である。

【図5】図4に示した回折型レンズの略断面図である。 【符号の説明】

30 1・・・部位 2・・・底部 3,4,5・・・レジスト

L ・・・第1の工程で形成される回折格子 L ・・・第2の工程で形成される回折格子

【図3】



【図 5】

領域I 領域II

【手続補正書】

【提出日】平成4年12月2日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】図1は本発明の原理を説明するための図であって、(a)は第1の工程で形成された断面形状が鋸歯状に加工された不等間隔回折格子の一部の領域を示す略断面図、(b)はこの回折格子の断面を分割する第2の工程を示す回折格子の略断面図、(c)は第2の工程で形成される回折格子の一部の領域を示す略断面図である。図中、L′は第1の工程で形成される回折格子、Lは第2の工程で形成される回折格子、Pは格子間隔、D

は格子厚である。ここで、この回折格子は第1の工程で3次の回折光で最適化されているとすると、1次の回折光で最適化されているとすると、1次の回折光で最適化された関域を形成するためには、同図(a)で示す回折格子の1周期分の断面構造を同図(b)に高部2が同一面内に揃うように区切り、底部2が同一面内に揃うように区切り、底部2が同一面内に揃うようにを1~3で形状は同図(a)の1周期分の鋸歯形状を1~3の大きさに縮小したものに相当する。同図(b)にような縮小したものに相当する。同図(c)であるが、これは第1の工程で形成された回折格ものに有いるであるが、これは第1の工程で形成された回折格ものにものにあるが、これは第1の工程で形成された回折格ものにもいるであるが、これは第1の工程で形成された回折格ものにもした上記式(2)、(3)より、このような操作をした領域が回折角を変化させずに、1次の回折光で最適化されていることがわかる。